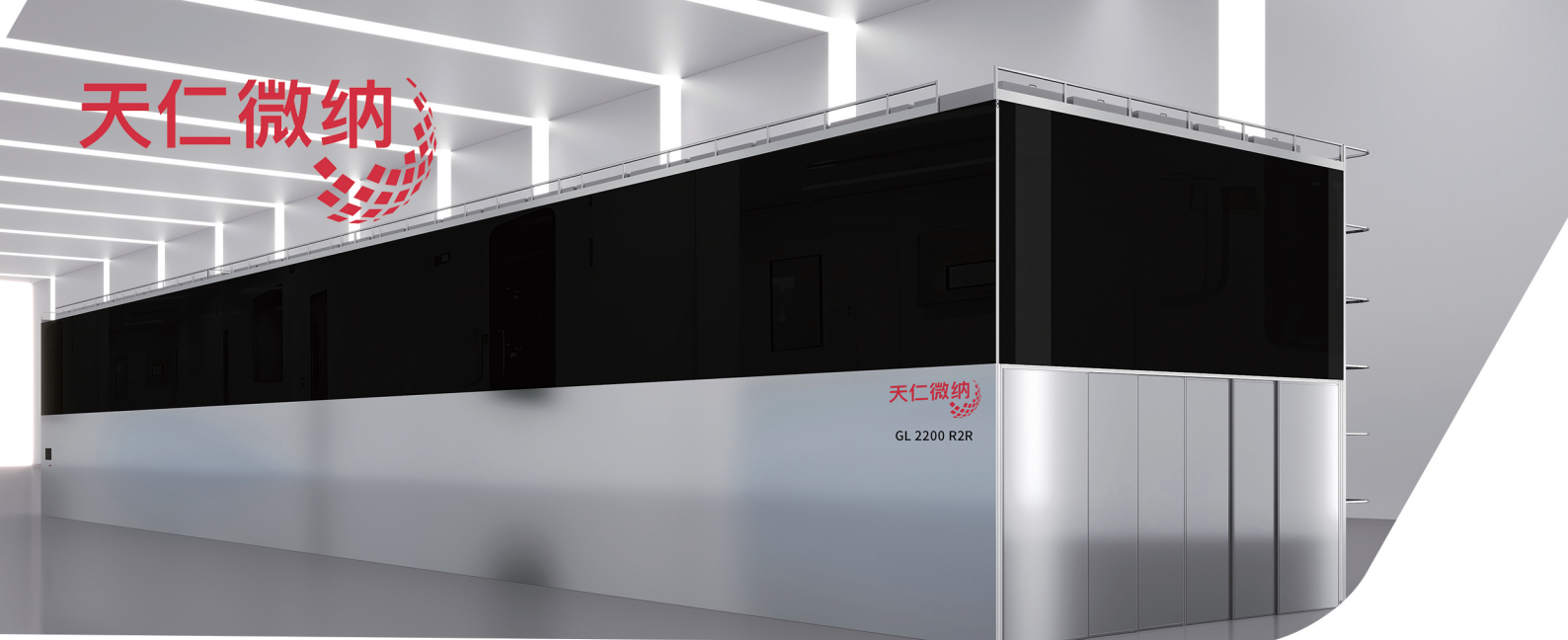




设备简介

GL 2200 R2R是天仁微纳新型全自动辊对辊 (Roll to Roll) 高精度紫外纳米压印光刻设备，可在1850mm~2200mm幅宽柔性基底上实现连续高速、高精度的微纳结构复制。设备包含高精度压印胶涂布工艺单元，可根据不同压印胶黏度范围灵活搭配不同涂布方式。

压印方式支持使用辊轮模具连续压印卷料柔性基底，同时还支持使用卷料柔性模具连续压印卷料柔性基底，两种压印方式可单一使用，亦可结合使用，方便灵活。GL 2200 R2R纳米压印光刻设备可用于连续生产适配于天仁微纳面板级辊对版压印设备 (GL P6 R2P) 所需的大幅面柔性复合工作模具，也适用于微透镜阵列、裸眼3D、AR/VR、LCD增亮膜以及电子纸等显示领域的研发和量产。

GL 2200 R2R

面板级纳米压印光刻设备 1850mm~2200mm幅宽 辊对辊纳米压印光刻设备

设备参数

压印幅宽	1850mm ~2200mm
支持基底材料	兼容PET、PC、PMMA、PE等各种卷料柔性基底
压印模具	支持铜辊、镍辊、聚合物表面结构辊轮等各种压印辊轮 同时支持柔性卷料模具压印柔性卷料基底
纳米压印技术	辊对辊紫外纳米压印 (Roll to Roll UV-NIL)
压印精度	优于50纳米*
涂布方式	支持狭缝涂布，逗号涂布等多种涂布方式
紫外固化光源	紫外LED (365nm) 光源，水冷冷却
连续自动压印	支持
连续自动脱模	支持
高精度张力控制	支持
高效胶水脱泡系统	支持
高效胶水过滤系统	支持
卷料自动纠偏功能	选配
产能	<20m/min*

*参数取决于模具、材料、工艺和使用环境，非设备极限

*天仁微纳保留对信息的解释权

主要功能

- 1850mm~2200mm幅宽全自动辊对辊高精度紫外纳米压印光刻设备；
- 辊对辊 (Roll to Roll) 纳米压印方式，确保在柔性基底上实现连续高速、高精度的微纳结构复制；
- 高精度压印胶涂布工艺单元，可适配各种压印胶黏度范围；
- 支持使用辊轮模具连续压印卷料柔性基底；
- 同时还支持使用卷料柔性模具连续压印卷料柔性基底，实现表面压印结构翻转复制；
- 压印前分离保护膜，压印后覆膜保护功能；
- 压印后表面二次熟化工艺，可显著提高在后续压印制程中软膜使用寿命；
- 自动压印、自动曝光固化、自动脱模，工艺过程无需人工干预；
- 标配高功率紫外LED光源 (365nm)，水冷冷却、特殊功率以及特殊、混合波长光源可订制，完美支持各种商用纳米压印材料与制程；
- 提供从设备客制化、厂务配套设计、材料选型与工艺流程联合开发、设备安装调试一直到驻厂陪同客户产品通线全周期保姆式服务，帮助客户零门槛达到国际领先的纳米压印水平。

OUR
CONTACT!

联系方式
青岛天仁微纳科技有限责任公司
青岛市城阳区祥阳路106号 青岛未来科技产业园6号楼
电话: 0532-67769322
传真: 0532-67768286
电子邮件: contact@germanlitho.com
网址: www.germanlitho.com

Qingdao GermanLitho Co., Ltd.
Building 6, No.106 Xiangyang Rd.,
Chengyang District Qingdao Future
Science and Technology Industrial
Park, China
Tel: 0532-67769322
Fax: 0532-67768286
E-mail: contact@germanlitho.com
Web: www.germanlitho.com